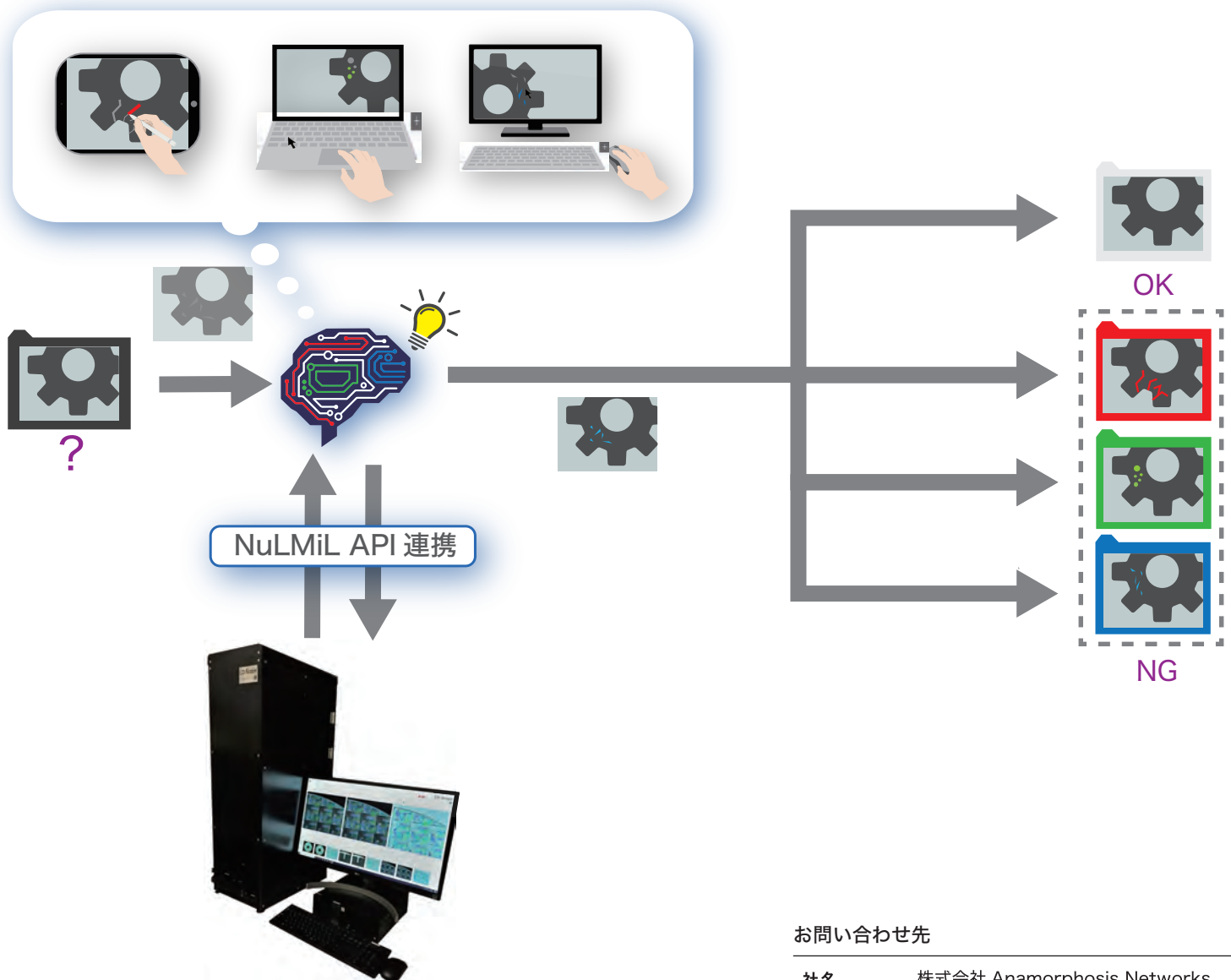


NuLMiL 連携 半導体検査装置

半導体ウェハ自動外観検査装置

最先端の撮影と最新手法の AI で、ウェハ検査の常識が変わる。



お問い合わせ先

社名	株式会社 Anamorphosis Networks
email	contact@anamorphosis.net
TEL	075-708-8744
FAX	075-708-8959



Anamorphosis Networks Co., Ltd.

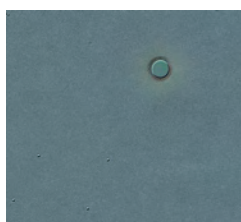
NuLMiL 連携 半導体検査装置とは

最先端 AI × 新感覚スコープの、半導体特化型自動外観検査装置

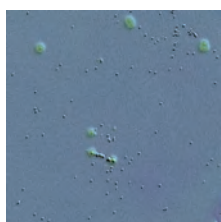
特殊な撮影手法と最先端の AI を組み合わせることにより、今まで目視では検査が困難であったシリコンウェハ表面膜や基板上に生じる欠陥や異物を誰でも簡単に自動検査・評価することが可能になります。

(検出例：スクラッチ、クラック、ディンプル、ウォーターマーク、スリップ、ソーマーク、ボイド)

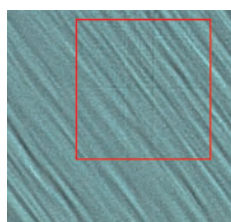
接合欠陥



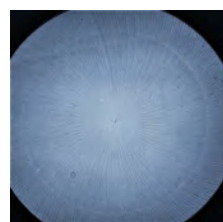
酸化膜欠陥



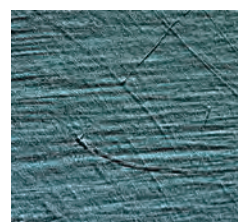
スリップ欠陥



ソーマーク欠陥



スクラッチ欠陥



NuLMiL 連携 半導体検査装置のココが凄い！

目視困難な微小欠陥を自動で検出・分類！

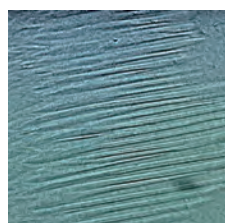
裸眼では確認が困難であったガラス・水晶・サファイアの表面に残るナノサイズの微細な研磨痕・オレンジピール・脈理・結晶欠陥などを、自動で検出することができます。検出した欠陥は、欠陥種別ごとに分類することが可能です。

ごっつ見えるけど過検出しない！？ 本装置による「シミ」欠陥の検出結果

欠陥を明瞭に撮影！（欠陥部は右下シミ）

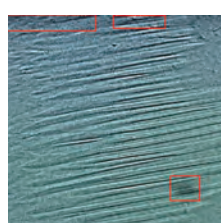


従来手法による撮影

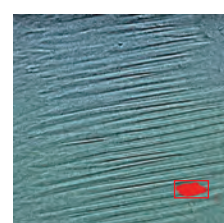


本装置による撮影

欠陥を過検出・誤検出なく検出！



従来手法の AI による欠陥検出結果
(誤検出多数)



本装置による欠陥検出結果
(正常に検出可能)

NuLMiL 連携 半導体検査装置による半導体ウェハ欠陥検出事例

Case1. 異物 (黄色)

Case2. ピンホール (紫)

Case3. スクラッチ (赤)

撮影画像



欠陥検出結果

